

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成18年9月14日(2006.9.14)

【公表番号】特表2006-500339(P2006-500339A)

【公表日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【年通号数】公開・登録公報2006-001

【出願番号】特願2004-525400(P2004-525400)

【国際特許分類】

C 0 7 D 305/12 (2006.01)

B 0 1 J 31/20 (2006.01)

C 0 7 B 61/00 (2006.01)

【F I】

C 0 7 D 305/12

B 0 1 J 31/20 Z

C 0 7 B 61/00 3 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成18年7月28日(2006.7.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

オキシランの接触カルボニル化によるラクトンの製造方法において、触媒として、

a) 成分Aとして少なくとも1種のコバルト化合物及び

b) 成分Bとして一般式(I)



[式中、

Mは、Al、Mg又はZnを表し、

Rは、水素又はC₁~C₃₂-アルキル、C₂~C₂₀-アルケニル、C₃~C₂₀-シクロアルキル、C₆~C₁₈-アリール、C₇~C₂₀-アラルキル又はC₇~C₂₀-アルカリアルを表し、その際、Mと結合した炭素原子以外の炭素原子に置換基が存在することができ、

Xは、Cl、Br、I、スルホナート、酸化物、C₁~C₃₂-アルコキシド又はアミドを表し、

nは、Mの原子価に相当する数を表し、

xは、0~nの範囲内の数を表し、

その際、n及びxは、電荷中性が生じるように選択される]の少なくとも1種の金属化合物

からなる触媒系を使用することを特徴とする、オキシランの接触カルボニル化によるラクトンの製造方法。

【請求項2】

反応条件下で、コバルトカルボニル化合物が存在するように成分Aを選択することを特徴とする、請求項1記載の方法。

【請求項3】

成分BはAlC_{1x}R_{3-x}であり、xは0~3の数であり、RはC₁~C₆-アルキルであることを特徴とする、請求項1又は2記載の方法。

【請求項4】

$\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3 / \text{Co}(\text{acac})_3$ の組み合わせを除く、請求項1から3までのいずれか1項記載の触媒。